

高解析掃描穿透式電子顯微鏡 TEM

● 儀器性能： 型號：JEM2100

1.解析度：

格子像 (Lattice Image) : 0.14nm

粒子像 (Point Image) : 0.19nm

2.試片座傾斜度：±25°

3.加速電壓：80~200KV

4.放大倍率：50~1.5M

5.電子槍系統：LaB6 燈絲

6.電子束直徑：最小 0.5nm



● 服務項目：

1.材料表面組織、斷面、微細組織、晶體結構及缺陷觀察分析。

2.全能譜定性(原子序 B5~U92)及半定量分析(含 EDS、Mapping、Linescan)。

3.電子繞射晶像判定。

4.數位影像系統，可作數位影像擷取及分析。

樣本準備需知：

● (本機台不受理磁性、高分子、有機物等樣品)

1.粉末採用鍍碳銅網 200~300mesh,D:3mm

2.材料薄化者厚度 < 100nm,D:3mm

3.試片製作由使用者自理

4.樣品須乾燥，在真空無揮發性

● 收費標準：

1.影像觀察+CCD 攝影(委託操作)：5,000/時段

2.影像觀察+CCD 攝影(自行操作)：2,000 元/時段

3.EDS(委託操作)：3,000 元/時段

EDS(自行操作)：1,000 元/時段

Linescan,Mapping(委託操作)：4,000 元/時段

Linescan,Mapping(自行操作)：1,500 元/時段

(操作以 3 小時為一時段計)

● 儀器負責人員連絡方式：

儀器專家：李勝隆教授 (03) 4227151#34325

儀器專家：鄭紹良教授 (03) 4227151#34233

技術人員：黃智詮先生 (03) 4227151#34009, allican@ncu.edu.tw

● 儀器放置地點：

中央大學工程五館 A114 室